資源エネルギー循環研究室

AFX 型ゼオライトの結晶性細孔構造の評価

学部4年 三津間 一輝

1. 研究目的

本研究では、CO₂分離吸着剤として DDR 型ゼオライトと AFX 型ゼオライトの比較を行った. DDR 型ゼオライトは細孔径が 0.36×0.44nm であるため分子ふるい効果によって CO₂/CH₄ 混合ガスから CO₂ を分離することが可能である.また、AFX 型ゼオライトは細孔径が 0.34×0.36nm であり細孔径が CO₂(0.33nm)に近いため CO₂分離に適していると考えられる.

CO₂/CH4 や CO₂/N₂の混合ガスから CO₂分離する材料として上記のゼオライトは利用可能とされているが特に AFX は比較的報告が新しいため細孔構造など物性が明らかになっていない部分が多い. そのため本研究では AFX 型ゼオライトの物性を既存の DDR 型ゼオライトと比較し AFX ゼオライトの細孔構造評価を行うことを目的とした.

2. ゼオライトの結晶合成

本研究では,表1,表2,表3に示す合成条件にてゼオライトの合成を行った.合成時間は72時間,96時間とした.今回合成を行ったZSM-58ゼオライトはSi/Al比を∞と70とした.本研究では,Si/Al=∞のZSM-58をAll-SilicaZSM-58,Si/Al=70の様にAlを含有するZSM-58をAlZSM-58と呼称する.また,SSZ-16の転換合成に使用したFAUゼオライトのSi/Al比を7.3と15した.また,今回合成を行ったSAPO-56のAL/Si比はと2.0と2.5としている.

sample	MTI/SiO ₂	NaAlO ₂ /SiO ₂	NaOH/SiO ₂	H ₂ O/SiO ₂	Si/Al	合成温度[℃]	合成時間[hour]
1	0.05	-	0.22	40	∞	1.00	70
2	0.25	0.014286	0.33	40	70	160	12

表 2 SSZ-16 合成条件

表 1 ZSM-58 合成条件

sample	DABCO-C4/SiO ₂	NaOH/SiO ₂	H ₂ O/SiO ₂	Si/Al	合成温度[℃]	合成時間[hour]
3	0.15	0.9	42	7.3	140	06
4	0.15	0.8	43	15	140	90

表 3 SAPO-56 合成条件

sample	DABCO-C4/SiO ₂	Al(OH) ₃ /SiO ₂	H ₃ O ₄ /SiO ₂	TrMA/SiO ₂	TBAOH/SiO ₂	H ₂ O/SiO ₂	合成温度[℃]	合成時間[hour
s	0.2	2.0	25	0.7	4	115	190	06
6	0.3	2.5	2.5	0.7	4	115	180	90

結晶の同定

・X線回折

結晶化度やフレームワークの判別および混晶の把握をするために X 線回折を行った.まず ZSM-58 の X 線回折パターンと IZA ホームページ¹に示されている X 線回折パターンを比較したものを図 1 として示す. X 線回折パターンのピーク位置が一致しているため、今回合成されたゼオライトは DDR 型 ゼオライトであると考えられる.しかし、①のピークでは 20~25°の付近でピーク幅が大きくなっているため、②に比べて結晶の純度が低いと考えられる.また、All-SilicaZSM-58 と AlZSM-58 では、X 線回折パターンに差少ないことがいえる.



次に、SSZ-16とSAPO-56の同定を行うためにZSM-58のX線回折結果と同様にIZAホームページ¹⁾ に示されているX線回折パターンを比較したものを図2として示す.XRDピークの位置を見ると、 IZAに示されているAFX型ゼオライトのピーク位置と一致しているため、今回合成したゼオライトは AFX型ゼオライトであると考えられる.各ピーク位置での強度がIZAのAFX型ゼオライトと違って いるが、これはIZAに示されているAFX型ゼオライトのピークはSAPO-56を基に作られたであり、 SSZ-16とは試薬や合成手順が違うため、同じフレームワーク同士でピーク強度比に違いが出ていると 考えられる.また、SAPO-56のXRDピークの位置を比較するとずれがある部分があるもののAFX型 ゼオライトのピーク位置と一致している箇所が多いため、AFX型ゼオライトが得られていると考えら れる.しかし、ピーク強度が弱いため、結晶化度が低く純度が低いと考えられる.



図 2AFX 型ゼオライトのX線回折結果

・走査式電子顕微鏡による結晶の撮影

結晶のフレームワークを X 線回折によって把握した が,結晶の形状がそれぞれの目的のゼオライトであるか 判別するために,走査式電子顕微鏡による撮影を行っ た.サンプルの撮影結果を図3に示す. まず,ZSM-58 結晶の撮影された結晶形状を確認する

まず,ZSM-58 結晶の撮影された結晶形状を確認する と、All-SilicaZSM-58 に見られるプレート状の結晶およ びの AlZSM-58 に見られる球形の結晶が確認できた.こ のことから、目的のゼオライトを得られているといえ る.また結晶のサイズを見ると、①が約 $4.2 \mu m$ 、②が約 $6.5 \mu m$ である.

次に ZSM-58 と同様に SSZ-16 結晶の形状を把握する ために走査式電子顕微鏡で撮影した画像を確認した.撮 影された結晶形状を確認すると、③、④ともに SSZ-16 に 見られる六方晶系の結晶が確認できた.このことから、 目的のゼオライトを得られているといえる.結晶のサイ ズを見ると、③が約 $14 \mu m$ 、④が約 $4 \mu m$ である.モル 比や合成時間、合成温度などの合成条件に違いがなく、 Si/Al 比の違いだけで結晶サイズに変化が生じているこ とが確認できる.

最後に SAPO-56 結晶の形状を把握するために走査式電 子顕微鏡で撮影した画像を確認した.撮影された結晶 は、SAPO-56 に見られる六角形のプレート状の結晶とな っていた.しかし、他2つのゼオライトと違い、結晶付 近に別の物質が確認できる.このことから目的のゼオラ イトを得られているが不純物が混じっており純度は低 いと考えられる.結晶のサイズを見ると、⑤が約9.4µm、 ⑥が約4.8µmであり、Si/Al 比以外の合成条件に違いが ないのに対して結晶サイズに違いが生じている.SSZ-16 の結果とこの SAPO-56 の結果から、Si/Al は結晶サイズ に影響を与える要因であると考えられる.



図 3 サンプルの走査式電子顕微鏡による撮影結果

4. 細孔特性の評価

・BET 比表面積

①~⑥の BET 比表面積および全細孔容積を表4として示す. BET 比表面積は④のサンプルが最も 大きく,全細孔容積も大きいため吸着量が大きく吸着剤としての性能が期待できると考えられる.また,DDR 型ゼオライトと AFX 型ゼオライトを比較すると,BET 比表面積および全細孔容積ともに AFX 型ゼオライトである③,④が優位性を示していることから,分子を吸着させた際 AFX 型ゼオライ トの方が,より多くの分子を吸着させることができると考えられる.

Sample名	BET比表面積(m²/g)	全細孔容積(cm³/g)
1	235	0.17
2	218	0.16
3	243	0.17
(4)	356	0.25
(5)	226	0.26
6	167	0.21

表 4 BET 比表面積および全細孔容積

吸着等温線

細孔構造の評価を行うために、77KN2吸着等温線の測定を行った.吸着等温線は横軸が相対圧,縦 軸が吸着量である.サンプルの吸着等温線を図4として示す.まず,ZSM-58の吸着等温線は低圧部で の立ち上がりが大きくある程度の吸着量に達した後吸着量が横ばいとなっていることが確認できる. これは、細孔径が吸着分子の直径に近いマイクロ孔を有しており、向かい合う細孔壁と吸着分子間で ポテンシャル場が重なり、強い吸着エネルギーが発生していると考えられるため、低圧部での立ち上 がりが大きくなっているといえる.²⁾このことから、本研究で作成した ZSM-58 結晶はマイクロ孔を有 していることが考えられる.

次に SSZ-16 の吸着等温線について述べる.吸着等温線は低圧部での立ち上がりが大きくある程度の 吸着量に達した後吸着量が横ばいとなっていることが確認できる.これは、ZSM-58 結晶と同様吸着分 子に近いサイズの細孔径を有しているため低圧部での立ち上がりが大きくなっているといえる.この ことから、本研究で作成した SSZ-16 結晶も ZSM-58 同様にマイクロ孔を有していると考えられる.また、ZSM-58 よりも吸着量が多くなっているが、これは、ZSM-58 の細孔径が 0.36×0.44nm であり SSZ-16 の細孔径が 0.34×0.36 であることから吸着質である N₂により近い細孔径を有しているため、吸着量 が ZSM-58 に比べて多くなったと考えられる. また、Si/AI 比が 7.3 のものより 15 の方が、吸着量が 多くなっている.

次に,SAPO-56 の吸着等温線について述べる.SAPO-56 の吸着等温線は低圧部での立ち上がりが他のゼオライトより小さく,吸着量が段階的に増加していることが確認できる.これは,低圧部ではマイクロ孔への吸着が発生し,その後違うサイズの細孔に吸着が発生していることを示している.このことから,本研究で合成された SAPO-56 はマイクロ孔以外の細孔が存在していると考えられるため,細孔形成が不完全であるといえる.



図 4 サンプルの吸着等温線

次に、AFX 型ゼオライトと他のゼオライトと比較するために、CHA 型ゼオライトとして SAPO-34 と MFI 型ゼオライトとして ZSM-5 の吸着等温線を図 5 として示す.³⁾この吸着等温線と本研究で得られたゼオライトを比較すると、SSZ-16 である④のサンプルは図 4 示されたゼオライトより、吸着量が大きく低圧部での立ち上がりも他のゼオライトより強いことが確認できた.一方、SAPO-56 は ZSM-5 と比較すると低圧部での立ち上がりが弱いため、ZSM-5 に比べて吸着力は低いと考えられる.



図 5 CHA 型ゼオライトと MFI 型ゼオライトの 77KN2 吸着等温線⁴⁾

最後に、各フレームワークの吸着等温線における低圧部での立ち上がりを見るために、縦軸を最大 吸着量に対する割合、横軸を相対圧の対数グラフにしたものを図6として示す.図6には比較を行う ために DDR 型ゼオライトとして①の吸着等温線、AFX 型ゼオライトとして④の吸着等温線を示した. また、吸着割合に対する相対圧の比較を行ったものを表5として示す.³³表5において CHA と MFI 型 ゼオライトの相対圧が文献から読み取れなかった部分は、1.0E-08~9.9E-04 としている表5から、吸着 割合に対するそれぞれの相対圧が最も低いのは、AFX 型ゼオライトである.また、図6の対数吸着等 温線の比較からも、AFX 型ゼオライト低圧部での立ち上がりが強く、低圧部で吸着量が大きいことが わかる.相対圧が低圧部である場ガス中の分子の濃度は低濃度となる.そのため、低圧部で吸着量が 大きい SSZ-16は、分子の濃度が低濃度でも吸着力が強いことがいえる.このことから、AFX 型ゼオ ライトは混合ガス中の分子濃度が低濃度でも選択的に目的分子を吸着させることができるといえる.



図 6 対数吸着等温線の比較

	AFX	DDR	СНА	MFI
V _{0.25}	2.52E-07	3.93E-06	1.0E-08~9.9E-04	1.0E-08~9.9E-04
V _{0.5}	4.21E-07	0.2105	0.23	1.0E-08~9.9E-04
V _{0.75}	2.22E-05	0.983	0.88	0.18

表5 吸着割合に対する相対圧の比較

5. 細孔径分布

HK 法によって算出された ZSM-58 と SSZ-16 の細孔径分布を図 7 として示す. ①のサンプルが有す る細孔の中で最も多い細孔径は 0.59nm, ②のサンプルでは 0.56nm となった. しかし, ②のサンプルを 見ると, 0.5~1.0nm 付近で複数のプロットが存在することから複数の細孔径を有していることが考え られる. そのため, ②のサンプルは細孔の形成が不完全である可能性が考えられる.

次に,SSZ-16の細孔径分布について述べる.③のサンプルが有する細孔の中で最も多い細孔径は 0.56m,②のサンプルでは0.54nmとなった.この結果から,SSZ-16の方がZSM-58より細孔径がより CO2の分子サイズに近い細孔径を有していることが考えられるため,AFX型ゼオライトの方がCO2吸 着剤として優位であると考えられる.また,縦軸の値もZSM-58より大きいためDDR型ゼオライトよ り、目的の細孔径である細孔を多く有していることが考えられるため、本研究で合成されたDDR型ゼ オライトよりAFX型ゼオライトの方が、純度も高いと考えられる.また、細孔径のバラツキもDDR 型ゼオライトに比べて少ないため、AFX型ゼオライトの方が優位性を示していると考えられる.



次に SAPO-56 の細孔径分布を図 8 として示す. ⑤のサンプル有する細孔の中で最も多い細孔径は 0.66nm, ⑥のサンプルでは 0.59nm となった. SAPO-56 の細孔径分布は他の二つのゼオライトと比較す ると,バラつきが大きく様々な細孔が存在していることが確認できる. また, 1.0nm 以上の細孔も存在 していることが確認できることから, SAPO-56 は目的の細孔径を得られず,細孔の形成が不完全であ ることが考えられる. また,細孔径のピークも他の二つより大きいため, CO2吸着力も他のゼオライト より低いと考えられる.



図 8 SAPO-56 の細孔径分布

最後に、CHA 型ゼオライトとMFI 型ゼオライトの細孔径分布を図9に示す. ⁴SSZ-16 の細孔径分布 と比較するとSSZ-16 の細孔径分布の方が、バラつきが少なくピークの立ち上がりも強いことが確認で きた.バラつきが少なくピークの立ち上がりが強いということは、細孔径のバラツキが少なく、目的 の細孔径を有したゼオライトが多く存在するということになる.そのため、CHA 型ゼオライトや MFI 型ゼオライトより、AFX 型ゼオライトである SSZ-16 の方が目的の細孔径を得られ、バラツキも少なく 純度の高いものが合成できているといえる.また、細孔径を比較すると SSZ-16 の方が細孔径が小さく より分子サイズに近いため、分子の吸着性能も CHA 型ゼオライトや MFI 型ゼオライトに比べて高いと いえる.



図 9 CHA 型ゼオライトと MFI 型ゼオライトの細孔径分布 3)

6. まとめ

- 本研究では、以下の知見を得ることができた.
- ・本研究で参考とした合成方法で ZSM-58, SSZ-16, SAPO-56 結晶の合成を行った結果, 走査式電子顕微鏡, X線回折から,結晶の合成は成功していると考えられる.しかし, SAPO-56 はピークが弱いため純度が低いと考えられる.
- ・吸着等温線を測定した結果,SSZ-16である④が最も高い吸着量を示したこと,DDR型ゼオライト, AFX型ゼオライトの各相対圧での吸着度合いを比較した結果,AFX型ゼオライトが低圧部での吸着 度合いが高かったことから、AFX型ゼオライトは低濃度でも分子を選択的に吸着させることがで き、その吸着量も高いため、吸着剤として優位性を示していると考えられる。
- ・BET 比表面積と全細孔容積において,SSZ-16 である④のサンプルが最も大きい値を示していること,ZSM-58 より比表面積や全細孔容積が大きいことから,AFX 型ゼオライトは分子吸着をさせた際,より多くの分子を吸着させることが可能である.
- ・細孔径分布の結果から、ZSM-58 と SSZ-16 は目的の細孔径が形成されていると考えられる一方, SAPO-56 は細孔径分布にバラつきがあるため、細孔の形成が不完全であると考えられる.また、細 孔径を比較した場合、SSZ-16 の方が CO₂の分子サイズに近い細孔径が多く存在するため、AFX 型ゼ オライトは CO₂吸着剤として利用可能である.

参考文献

- 1) IZA ホームページ: Structure Commission (http://www.iza-structure.org/) (2021 年 2 月現在)
- 2) 近藤 精一, 石川 達雄, 安部 郁夫: 吸着の化学, 丸善株式会社, p68-70, (2011)
- Ling Zhang, Zhong-Xiang Jiang, Yue Yu, Chong-Shuai Sun, Yu-Jia Wangb and Hai-Yan Wang : Synthesis of core-shell ZSM-5@meso-SAPO-34 composite and its application in methanol to aromatics. RSC Advances, (2015)